## В. А. ДЕНИСОВ, Ю. И. СТЕБЛЕВ, В. И. ШАТЕРНИКОВ

## РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ПРОВОДНИКОВОГО ВИХРЕТОКОВОГО ДАТЧИКА

При экспериментальных и теоретических исследованиях вихретоковых проводниковых датчиков применительно к практическим задачам контроля необходимо знать зависимость его параметров — комплексного сопротивления Z, индуктивности  $L_1$  и вносимого активного сопротивления  $R_1$  от измеряемых величин и мешающих факторов.

В данной работе определяются параметры вихретокового проводникового датчика без ферритового сердечника, находящегося над проводящей полуплоскостью или над ограниченной с двух сторон проводящей поверхностью. Расположение датчика над контролируемой поверхностью, система координат и все обозначения приняты те же, что и при расчете его поля [1].

Для вывода перечисленных выше зависимостей воспользуемся известным положением о том, что ток I, протекающий через нить, должен скомпенсировать не только падение напряжения от собственного полного сопротивления нити  $Z_0$ , но и падение напряжения от полного сопротивления проводящей поверхности  $Z_i$ , приведенное к первичной стороне. Падение напряжения на отрезке провода длиной l может быть выражено через напряженность поля  $E_{10}$  на поверхности провода:

$$\vec{I} \cdot \vec{Z}_1 = (R_1 + j \,\omega L_1) \vec{I} = \vec{E}_{10} \cdot \vec{l}.$$
(1)

Определим Е<sub>10</sub>, воспользовавшись формулой

$$\dot{E}_{10} = -j \,\omega A_{10},\tag{2}$$

где  $A_{10}$  — вектор-потенциал внешнего поля в точке с координатамн  $v = v_0$ ; u = 0. Используя [1, 2], где дается выражение для А<sub>1</sub>, получим

$$Z_{1} = \frac{\dot{E}_{10} \cdot l}{J} = -j \,\omega \mu_{1} \frac{l}{2\pi} \left[ \ln \sqrt{\frac{(v_{0} + v)^{2} + u^{2}}{(v_{0} - v)^{2} + u^{2}}} - 2 \int_{0}^{\infty} \frac{-e^{-2v_{0}\lambda}}{\lambda + \sqrt{\lambda^{2} + jk^{2}}} d\lambda \right]$$
(3)

1-й член для координат  $v = v_0$ ; u = 0 является физической неопределенностью, и, чтобы от нее избавиться, вводится радиус провода  $r_0$ , после чего это слагаемое примет вид

$$\lim_{\substack{v \to -(v_0+r_0)\\ u \to 0}} \ln \frac{1}{(v_0-v)^2 + u^2} = \ln \frac{R_0}{2v_0} \quad \text{при } v_0 \gg r_0, \tag{4}$$

где  $R_0 = \operatorname{sh} \frac{\pi r_0}{2x_0}.$ 

Для нахождения 2-го слагаемого в выражении (3) требуется вычислить интеграл

$$L = \int_{0}^{\infty} \frac{e^{-2v_{0}\lambda}}{\lambda + \sqrt{\lambda^{2} + jk^{2}}} d\lambda.$$
 (5)

Согласно [3] он выражается в конечном виде через функции Струве — *H*, и Неймана *N*, комплексного аргумента:

$$L = \frac{\pi}{2\sqrt{2}k_1v_0(1+j)} |H_1[\sqrt{2}v_0k_1(1+j)] - N_1[\sqrt{2}v_0k_1(1+j)]| - \frac{1}{j4v_0^2k_1^2}$$
(6)

Однако применять для каких-либо расчетов выражение (6) не представляется возможным, поэтому преобразуем его с помощью асимптотического представления функции Струве [3].

$$H_{\nu}(\xi) = N_{\nu}(\xi) + \frac{1}{\pi} \sum_{m=0}^{p-1} \frac{\Gamma\left(m + \frac{1}{2}\right) \left(\frac{s}{2}\right)^{-2m + \nu - 1}}{\Gamma\left(\nu + \frac{1}{2} - m\right)^2} + O(|\xi|^{\nu - 2p - 1}).$$
(7)

Эта формула применяется для больших значений  $|\xi| = 2v_0k_1$  и не пригодна при достаточно малых  $|\xi|$ .

Если задаться относительной погрешностью (1%), то  $|\xi|$  должно быть больше 5. В этом случае берется один или два члена ряда (7) и окончательное выражение для  $Z_1$  записывается в виде:

$$\dot{z} = -\frac{\mu_0 \omega l}{\pi} \left[ \frac{1}{2k_1^2 v_0^2} - \frac{1}{\sqrt{2} k_1 \cdot v_0} + j \left( \ln \frac{R_0}{2v_0} - \frac{1}{\sqrt{2} k_1 v_0} \right) \right].$$
(8)

Определим *L* другим способом, выделив в (8) действительную и мнимую части подынтегрального выражения и проделав необходимые операции, получим

$$\int_{\infty}^{\infty} \frac{l-2\upsilon_s\lambda}{\lambda+\sqrt{k^2+\frac{2}{1}}} d\lambda L = j \left( \frac{1}{4\upsilon_0^2 k_1^2} - \frac{1}{\sqrt{2} k_1^2} \int_{0}^{\infty} \sqrt{\sqrt{\lambda^4+k_1^4}+\lambda^2} l^{-2\upsilon_s\lambda} d\lambda + \right)$$

107

$$+\frac{1}{\sqrt{2}k_1^2}\int_0^\infty \sqrt{\sqrt{\lambda^4+k_1^4-\lambda^2}}l^{-2\upsilon_b\lambda}d\lambda).$$
(9)

Несобственные интегралы

$$c = \frac{1}{\sqrt{2} k_1^2} \int_0^\infty \sqrt{\sqrt{\lambda^4 + k^4} - \lambda^2} l^{-2\upsilon_0 \lambda} d\lambda, \qquad (10)$$

$$d = \frac{1}{\sqrt{2} k_1^2} \int_0^\infty \sqrt{\sqrt{\lambda^4 + k^4} + \lambda^2} \, l^{-2v_0\lambda} \, d\lambda \tag{11}$$

могут быть вычислены на ЭВМ. Запишем короче

$$L = c + j \left(\frac{1}{4v_0^2 k_1^2} - d\right).$$
 (12)

Рассмотрим некоторые особенности поведения интегралов с и d, необходимые для оценки остаточного члена при приближенном интегрировании и зазисимость L от параметра  $k_1$ .

1. При  $k_1 = 0$  выкладки (10)  $\div$  (11) теряют смысл, но сам интеграл L упрощается:

$$\int_{0}^{\infty} \frac{l - 2v_{0}\lambda}{2\lambda} d\lambda = \ln \sqrt{2v_{0}}.$$
(13)

2. Оценка погрешности при приближенном вычислении несобственных интегралов c и d. Если ввести новую переменную  $\xi = v_0 \lambda$ , то интеграл c переходит в другую форму

$$c = \frac{1}{\sqrt{2}m} \int_{0}^{\infty} \sqrt{\sqrt{\left(\frac{\xi}{m}\right)^{4} + 1}} - \left(\frac{\xi}{m}\right)^{2} l^{-2\xi} d\xi, \qquad (14)$$

где  $m = v_0 k_1$ .

Очевидно, что этот интеграл — функция только *m*. Рассмотрим остаточный член при интегрировании:

$$\Delta = \frac{1}{\sqrt{2m}} \int_{q}^{\infty} \sqrt{\sqrt{\left(\frac{\xi}{m}\right)^{4} + 1}} - \left(\frac{\xi}{m}\right)^{2} l^{-2\xi} d\xi \leq \frac{1}{\sqrt{2m}} \int_{q}^{\infty} l^{-2\xi} d\xi = \frac{1}{2\sqrt{2m}} l^{-2q}, \qquad (15)$$

$$q > \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2\sqrt{2} m\Delta} . \tag{16}$$

Аналогичная оценка может быть выполнена и для интеграла d,

$$\Delta = \frac{1}{\sqrt{2}m} \int_{0}^{\infty} \sqrt{\sqrt{\left(\frac{\xi}{m}\right)^{4} + 1} + \left(\frac{\xi}{m}\right)^{4}} l^{-2\xi} d\xi \leq 1$$

108

$$\leq \frac{1}{m^2} \int_{0}^{\infty} \xi e^{-2\xi} d\xi = \frac{1}{4m^2} (2q+1) e^{-2q}, \tag{17}$$

где  $4m^2 \Delta < (2q+1) e^{-2q}$ . (18)



Рис. 1. Интегралы с и d

- Эти результаты используются для оценки погрешности при вычислении интегралов с и d.

Расчет интегралов с и d был произведен на ЭВМ «Проминь-М». Результаты расчета приведены на рис. 1.

При значениях  $v_0k_1>2$  интегралы с и d равны. В этом случае искомый интеграл равен

$$L = \frac{1}{2v_0k_1} + j \frac{1 - 2v_0k_1}{4v_0^2 k_1^2} \,. \tag{19}$$

Аппроксимируя интегралы c и d (рис. 1), для  $v_0k_1 > 1,5$  и  $v_0k_1 < 1,5$ , получим:

$$\dot{z}_{1} = -\frac{\mu_{0} \omega l}{\pi} \cdot \left[ \frac{1}{2k_{1}^{2}v_{0}^{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}k_{1}v_{0}} + j\left( \ln \frac{R_{0}}{2v_{0}} - \frac{1}{\sqrt{2}k_{1}v_{0}} \right) \right]$$
(20)  
для  $v_{0}k_{1} > 1.5.$ 

$$z_{1} = -\frac{\mu_{0} \cdot \omega \cdot l}{2\pi} \left[ \frac{1}{2v_{0}^{2} k_{1}^{2}} - \frac{2}{1.9v_{0}k_{1}} + j \left( \ln \frac{R_{0}}{2v_{0}} - \frac{1}{1.4v_{0}k_{1}} \right) \right]$$
(21)

для к<sub>1</sub>v<sub>0</sub><1,5.

После перехода к системе координат Х—У окончательно получим

$$R_{1} = \frac{\omega \mu_{0} \cdot l}{2 \sqrt[4]{2} \cdot x_{0} k \sinh \frac{\pi y_{0}}{2 x_{0}}} \left( 1 - \frac{\pi}{2 \sqrt[4]{2} x_{0} k \sinh \frac{\pi y_{0}}{2 x_{0}}} \right), \quad (22)$$

109

$$X_{1} = \frac{\omega \cdot \mu_{0} l}{\pi} \left( -\ln \frac{R_{0}}{2 \operatorname{sh} \frac{\pi y_{0}}{2 x_{0}}} + \frac{\pi}{2 \sqrt{2} k x_{0} \operatorname{sh} \frac{\pi y_{0}}{2 x_{0}}} \right)$$
(23)

для  $v_0 k_1 > 1,5.$ 

$$R_1 = \frac{\omega \mu_0 l}{2x_0 k \cdot \operatorname{sh} \cdot \frac{\pi y_0}{2x_0}} \left( 0.526 - \frac{\pi}{8kx_0 \operatorname{sh} \cdot \frac{\pi y_0}{2x_0}} \right) , \qquad (24)$$

$$X_{1} = \frac{\omega \mu_{0} l}{2\pi} \left( -\ln \frac{R_{0}}{2v_{0}} + \frac{\pi}{2,8kx_{0} \cdot \sinh \frac{\pi y_{0}}{2x_{0}}} \right)$$
(25)

для v<sub>0</sub>k<sub>1</sub> < 1,5.

Таким образом, получены приближенные выражения для расчета параметров проводниковых вихретоковых датчиков. Более точные результаты можно получить, произведя графо-аналитический расчет.



Для случая полупространства, т. е. 2x<sub>0</sub>>>y<sub>0</sub> будем иметь следующие выражения:

$$R_{1} = \frac{\omega \mu_{0} \cdot l}{\pi \sqrt{2} k y_{0}} \left( 1 - \frac{1}{\sqrt{2} k y_{0}} \right), \tag{26}$$

$$X_{1} = \frac{\omega \varphi_{0} l}{\pi} \left( -\ln \frac{R_{0}}{2v_{0}} + \frac{1}{\sqrt{2} k y_{0}} \right)$$
(27)



Рис. 3. Зависимость вносимого реактивного сопротивления от  $\beta = ky_0$  для различных значений  $\alpha$ 

По формулам (22—27) построены графики, которые приведены на рис. 2, 3.

Пользуясь выражениями (22÷25), можно определить погрешность измерения датчика в зависимости от толщины пластины.

Пример. При k = 0,025,  $y_0 = 150$  мкм, а  $x_0 = 1500$  мкм, получим  $\frac{R_1}{\omega\mu_0}$ . =0,048. Допустим, что пластина по ширине имеет допуск ±10%, тогда  $\frac{R_1}{\omega\mu_0\Delta} = 0,0466$ , т. е. погрешность  $\delta \% = \frac{\Delta R_1}{R_1} \cdot 100\% = 2,92\%$ .

Эту погрешность можно определить и графически при разных k, т. е. для различных материалов. Полученные теоретические кривые подтверждены экспериментально.

Из графиков (рис. 2, 3), видно, что при  $\frac{y_0}{2x_0} < 0,2$  для приведенных k пластину можно рассматривать как бесконечную по оси x.

Таким образом, теоретические и экспериментальные исследования показывают, что при  $\frac{y_0}{2x_0} < 0,2$  ширина пластины практически не влияет на результаты вычислений, и действие ее на вносимые параметры датчика можно рассматривать как действие проводящего полупространства, при этом погрешность не превышает 10%.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Автоматические измерительные и регулирующие устройства, вып. VI,

Автоматические измерительные и регулирующие устроиства, вып. VI,
 г. Куйбышев, 1970.
 2. М. Ш тафль. Электродинамические задачи в электрических машинах,
 г. Москва, 1966.
 3. И. Е. Градштейн и И. М. Рыжик. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений. Москва, ФМ, 1963.